# OBJECTIVE LENS DRIVING DEVICE

F4

**Publication number:** 

JP9035297

Publication date:

1997-02-07

Inventor:

NAGUMO HIROFUMI

Applicant:

**SONY CORP** 

Classification:

- international:

G11B7/09; G11B7/09; (IPC1-7): G11B7/09

- european:

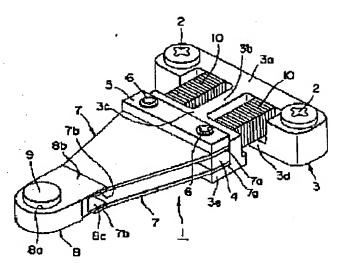
Application number: Priority number(s):

JP19950183644 19950720 JP19950183644 19950720

Report a data error here

#### Abstract of JP9035297

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an objective lens driving device capable of exhibiting high-speed access performance by improving the vibration resistance and impact resistance in biaxial directions; a focusing direction and a tracking direction. SOLUTION: The objective lens driving device 1 used for an optical pickup device has an objective lens 9 for condensing the light beam emitted from a light source to a signal recording surface of a magneto-optical disk, etc. The device has a pair of bimorph type piezoelectric elements 7, 7 which freely movably support this objective lens 9 in the focus direction via a lens holder 8 and a pair of laminated piezoelectric elements 10, 10 which support a pair of these bimorph type piezoelectric elements 7, 7 via the hinge part 3b, etc., of a base 3 in such a manner that the objective lens 9 is movable in the tracking direction. The objective lens 9 is driven in the focus direction in the vertical direction by the distortions of the respective bimorph type piezoelectric elements 7, by which the focusing adjustment is executed. The objective lens is driven in the tracking direction in the lateral direction by the distortions of the respective laminated piezoelectric elements 10, by which the tracking adjustment is executed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平9-35297

(43)公開日 平成9年(1997)2月7日

(51) Int.Cl.6 G11B 7/09 識別記号

庁内整理番号 9646-5D

FΙ G11B 7/09 技術表示箇所

D

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平7-183644

(22)出願日

平成7年(1995)7月20日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 南雲 浩文

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

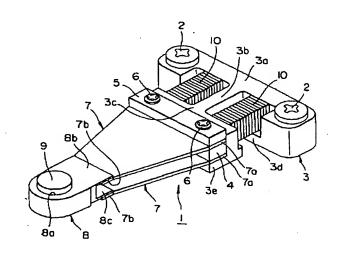
(74)代理人 弁理士 志賀 富士弥 (外1名)

#### (54) 【発明の名称】 対物レンズ駆動装置

#### (57)【要約】

フォーカス方向とトラッキング方向の2軸方 向の耐振性と耐衝撃性を改善して高速なアクセス性能を 発揮できる対物レンズ駆動装置を提供する。

【解決手段】 光学ピックアップ装置に用いられる対物 レンズ駆動装置1は、光源から出射される光ビームを光 磁気ディスク等の信号記録面に集光させる対物レンズ9 と、この対物レンズ9をレンズホルダー8を介してフォ ーカス方向に可動自在に支持した一対のバイモルフ型圧 電素子7,7と、この一対のバイモルフ型圧電素子7, 7をベース3のヒンジ部3b等を介して対物レンズ9が トラッキング方向に可動するように支持した一対の積層 型圧電素子10,10とを備えている。そして、対物レ ンズ9を各バイモルフ型圧電素子7の歪曲で上下方向の フォーカス方向に駆動させてフォーカス調整を行い、ま た、各積層型圧電素子10の歪曲で左右方向のトラッキ ング方向に駆動させてトラッキング調整を行う。



′…対物レンズ駆動装置

3 b…ヒンジ部

パイモルフ型圧電素子(フォーカス調整駆動用圧電案子)

a…基端部(他端部)

b…先端部(一端部)

…レンズホルダ

9…対物レンズ

10…積層型圧電索子(トラッキング調整駅動用圧電索子)

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】 対物レンズと、

この対物レンズをその光軸方向であるフォーカス方向に 可動自在に支持したフォーカス調整駆動用圧電素子と、 上記対物レンズをその光軸と直交する方向であるトラッ キング方向に可動自在に支持したトラッキング調整駆動 用圧電素子とを備え、

上記対物レンズを、上記フォーカス調整駆動用圧電素子 及びトラッキング調整駆動用圧電素子を介して上記フォ ーカス方向及びトラッキング方向に駆動変位させるよう にした対物レンズ駆動装置において、

上記フォーカス調整駆動用圧電素子にバイモルフ型圧電 素子を用いる一方、

上記トラッキング調整駆動用圧電素子に積層型圧電素子 を用いたことを特徴とする対物レンズ駆動装置。

【請求項2】 請求項1記載の対物レンズ駆動装置にお いて、

上記バイモルフ型圧電素子を互いに平行になるようにベ ースに一対配設し、

この一対のバイモルフ型圧電素子の一端部にレンズホル ダーを介して上記対物レンズを取り付け、

上記一対のバイモルフ型圧電素子の他端部側の上記ベー スの中央にヒンジ部を形成し、

このベースのヒンジ部を挾むようにして上記積層型圧電 素子を一対配設したことを特徴とする対物レンズ駆動装

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、例えば、光ディ スク或は光磁気ディスク駆動装置の光学ピックアップ装 30 置等に用いられ、光源から出射される光ビームを光ディ スク或は光磁気ディスク等の信号記録面に集光させる対 物レンズを、互いに直交するフォーカス方向及びトラッ キング方向の 2 軸方向に駆動変位させるようにした対物 レンズ駆動装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】例えば、光磁気ディスク駆動装置では、 光磁気ディスクの信号記録面に記録された情報信号を読 み取ったり、所定の情報信号を上記光磁気ディスクの信 号記録面に書き込む手段として光学ピックアップ装置が 用いられている。この光学ピックアップ装置には、光源 としての半導体レーザから出射された光ビームを上記信 号記録面に集束させる対物レンズを、互いに直交するフ ォーカス方向及びトラッキング方向の2軸方向に駆動変 位させることによって、上記光ビームが上記信号記録面 に合焦して記録トラックを正確に走査するようにした対 物レンズ駆動装置が配設されている。

【0003】この対物レンズをフォーカス方向とトラッ キング方向の2軸方向に駆動させるアクチュエータとし タを採用する場合が多い。しかし、このVCM方式は制 御用駆動コイルと磁石による電磁力駆動方式であるの で、対物レンズを応答性良く可動変位させるために磁石 等から発生する磁束を増加させると、磁束の漏洩が多く なり、情報信号の記録の際に光ビームとともに磁力を用 いる光磁気ディスク等の記録媒体に対して悪影響を及ぼ す虞れがあった。

【0004】そこで、対物レンズが応答性良く駆動変位 され、磁束の漏洩のない対物レンズ駆動装置が、例えば 10 特開平1-100742号公報に開示されている。これ を、図5によって具体的に説明する。図5は、光磁気デ ィスク駆動装置等に内蔵された光学ピックアップ装置に 用いられる対物レンズ駆動装置1″を示す。この対物レ ンズ駆動装置1″は、図示しない光学ピックアップ装置 のキャリッジ等に取り付けられるベース3″を備えてい る。このベース3″の前面中央に垂直に形成された凹溝 部3fには、トラッキング調整駆動用圧電素子としての バイモルフ型圧電素子7″を所定手段により固定してあ る。このバイモルフ型圧電素子 7″の先端にはスペーサ 4を固定してある。このスペーサ4の上下面にはフォー カス調整駆動用圧電素子としての上下一対のバイモルフ 型圧電素子7,7の各基端部を固定してある。この一対 のバイモルフ型圧電素子7,7の先端部にはレンズホル ダー8の一対のヒンジ部8b,8cを固定してある。こ のレンズホルダー8の中央の孔部8aには対物レンズ9 を保持してある。

【0005】上記対物レンズ9は、光学ピックアップ装 置に内蔵された光源としての半導体レーザから出射され た光ビームを光磁気ディスクの信号記録面に集束させる ためのものであり、その光軸方向であるフォーカス方向 にフォーカス調整駆動用の一対のバイモルフ型圧電素子 7, 7により駆動変位すると共に、フォーカス方向と直 交する方向であるトラッキング方向にトラッキング調整 駆動用のバイモルフ型圧電素子7″により駆動変位す る。これにより、対物レンズ9をその光軸方向に駆動制 御させるフォーカス制御と、対物レンズ9を上記光磁気 ディスクの記録トラックに追従させるトラッキング制御 が行われる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の対物レンズ駆動装置1″では、対物レンズ9をフォ ーカス方向及びトラッキング方向に駆動変位させるフォ ーカス調整駆動用圧電素子及びトラッキング調整駆動用 圧電素子に、機械的剛性が低いバイモルフ型圧電素子 7, 7″をともに用いて且つ一体的に連結してあるた め、フォーカス方向とトラッキング方向の両方向におい て高い剛性を持たせることは困難であり、該両方向の耐 振性、耐衝撃性をともに改善することは困難であった。 尚、上記対物レンズ 9 が振動衝撃を受けた時に動き易い ては、ボイスコイルモータ(VCM)方式のリニアモー 50 と、デフォーカス(対物レンズがフォーカス方向から外 れること) やオフトラック (対物レンズがトラッキング 方向から外れること)が生じ易い。

【0007】また、上記対物レンズ9を支持する各バイ モルフ型圧電素子7,7"の機械的な振動特性に依り、 いわゆる高次共振が発生する虞れがあった。即ち、対物 レンズ駆動装置1″を用いる光学ピックアップ装置にお いては、情報信号の再生出力よりフォーカスエラー信号 を生成し、このフォーカスエラー信号に基づいて対物レ ンズ9を駆動変位させるいわゆる閉ループ制御を行って いるため、対物レンズ駆動装置1″における高次共振が 10 増大すると、髙周波数帯域において高ゲインの駆動制御 を行うことができない。高周波数帯域において高ゲイン の駆動制御が行えない(サーボゲインを高めることがで きない)と、高密度に記録された情報信号を高速で読み 取ったり、高速で書き込むことが困難となり、高速なア クセス性能を発揮することが困難であった。

【0008】そこで、この発明は、フォーカス方向とト ラッキング方向の両方向において構造的に高剛性であり ながら広い周波数帯域に亙ってサーボゲインを高めるこ ることができる対物レシズ駆動装置を提供するものであ る。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】対物レンズと、この対物 レンズをその光軸方向であるフォーカス方向に可動自在 に支持したフォーカス調整駆動用圧電素子と、上記対物 レンズをその光軸と直交する方向であるトラッキング方 向に可動自在に支持したトラッキング調整駆動用圧電素 子とを備え、上記対物レンズを、上記フォーカス調整駆 動用圧電素子及びトラッキング調整駆動用圧電素子を介 30 して上記フォーカス方向及びトラッキング方向に駆動変 位させるようにした対物レンズ駆動装置において、上記 フォーカス調整駆動用圧電素子にバイモルフ型圧電素子 を用いる一方、上記トラッキング調整駆動用圧電索子に 積層型圧電素子を用いている。

【0010】フォーカス調整駆動用圧電素子として機械 的剛性の低いバイモルフ型圧電素子を用い、また、トラ ッキング調整駆動用圧電素子として機械的剛性の高い積 層型圧電素子を用いてこれらを組み合わせた構造とした ので、対物レンズのフォーカス方向及びトラッキング方 40 向の両方向においてともに高い剛性になって耐振性・耐 衝撃性が大幅に改善される。

#### [0011]

【発明の実施の形態】以下、この発明の具体的な実施形 態例について図面を参照して説明する。

【0012】図1~図3は、この発明の第1の実施形態 例の対物レンズ駆動装置1を示す。この対物レンズ駆動 装置1は、光磁気ディスク駆動装置に内蔵された光学ピ ックアップ装置に用いられるものであり、光学ピックア

を介して取り付けられるベース3を備えている。このベ ース3は、ステンレスやスティール等の金属製であり、 両側に図示しないネジ挿入孔を有した後部3aと、この 後部3aの中央において該後部3aに対して垂直に且つ 薄肉にして弾性変形するように一体突出形成されたヒン ジ部3 b と、このヒンジ部3 b の先端部において上記後 部3aと平行になるように一体形成された前部3cとで 平面略工字状になっている。

【0013】ベース3の後部3aの前面下部には鍔部3 dを一体突出形成してあると共に、前部3cの前,後面 の下部には鍔部3 eを一体突出形成してある。この鍔部 3 e の上面の前側には金属製のスペーサ4と金属製の取 付板5及びネジ6を介してフォーカス調整駆動用圧電素 子としての上下一対のバイモルフ型圧電素子7, 7の各 基端部(他端部) 7 a をそれぞれ締結固定してある。こ の各バイモルフ型圧電素子7は、例えば金属板等よりな る基材を有し、この基材の両面または片面にセラミック ス等を被着し、このセラミックス等の層上に金属薄膜等 からなる電極を形成することにより構成してある。そし とができ、かつ耐振性・耐衝撃性をより一段と向上させ 20 て、この電極に電圧が印加されることにより電圧の極性 及び電位に応じた厚み方向の歪曲を生ずるように形成し てある。また、各バイモルフ型圧電素子7は、振動特性 を良好に保つために略台形板状に形成してあると共に、 ベース3の前部3c側に上下一対相互に平行になるよう に配置されて後述する対物レンズ9が水平状態を維持し た状態で確実に上下方向に平行移動するようになってい る。

> 【0014】一対のバイモルフ型圧電素子7、7の各先 端部 (一端部) 7 bには、合成樹脂製のレンズホルダー 8を固定してある。このレンズホルダー8の上面略中央 部には貫通した孔部8aを形成してあると共に、その 上、下面には後方に延びて弾性変形する一対のヒンジ部 8 b, 8 c を一体突出形成してある。このレンズホルダ -8の孔部8aには対物レンズ9を挿入、保持してあ る。また、レンズホルダー8の上側のヒンジ部8bの下 面は上方のバイモルフ型圧電素子7の先端部7bの上面 に接着剤等により固着されていると共に、レンズホルダ -8の下側のヒンジ部8cの下面は下方のバイモルフ型 圧電素子7の先端部7bの上面に接着剤等により固着さ れている。さらに、レンズホルダー8の上側のヒンジ部 8 bの下面と下側のヒンジ部8 cの下面との間の距離 は、スペーサ4の高さ(上面と下面の距離)と等しくな るようになっている。

【0015】対物レンズ9は、光学ピックアップ装置に 内蔵された光源としての半導体レーザから出射された光 ビームを光磁気ディスクの信号記録面(いずれも図示省 略)に集束させるためのものであり、その光軸方向であ るフォーカス方向にフォーカス調整駆動用の一対のバイ モルフ型圧電素子7,7により駆動変位すると共に、フ ップ装置のキャリッジ(いずれも図示省略)等にネジ2 50 ォーカス方向と直交する方向であるトラッキング方向に

トラッキング調整駆動用の後述する一対の積層型圧電素 子10,10により駆動変位するようになっている。

【0016】ベース3の後部3aの前面と前部3cの後 面との間には、ヒンジ部3bを挟むように且つ該ヒンジ 部3bと平行になるように一対の積層型圧電素子(トラ ッキング調整駆動用圧電素子) 10,10を介在してあ る。この各積層型圧電素子10は、上記各バイモルフ型 圧電素子7と略同様に構成された例えば金属板等の基材 と、この基材の両面または片面に被着されたセラミック ス等と、このセラミックス等の層上に金属薄膜等からな 10 る電極とを、複数層に積層して成るものであり、各層の 電極に電圧が印加されることにより、電圧の極性及び電 位に応じた積層方向の歪曲を生ずるように形成してあ る。また、各積層型圧電素子10の底面はベース3の後 部3aの前面に接着剤等により固着されるか、或はネジ 等で押し付けられると共に、各積層型圧電素子10の上 面はベース3の前部3cの後面に当接している。

【0017】以上の第1の実施形態例の対物レンズ駆動 装置1によれば、図2 (a) に示す状態から一対のバイ モルフ型圧電素子7,7に、光学ピックアップ装置によ り検出されたフォーカスエラー信号に基づく電圧がそれ ぞれ印加されると、各バイモルフ型圧電素子7がそれぞ れ上下方向(図2(b)に示す場合にはZ方向)及び所 定量の歪曲を生じ、対物レンズ 9 がその光軸方向である フォーカス方向に可動制御されてフォーカス調整され、 光磁気ディスクの信号記録面上の所定位置に光ビームが 正確に集光するようになる。また、図3 (a) に示す状 態から一対の積層型圧電素子10,10に、光学ピック アップ装置により検出されたトラッキングエラー信号に 10がそれぞれ左右方向(図3(b)に示す場合にはZ 軸の回りの方向)及び所定量の歪曲を生じ、対物レンズ 9がその光軸と直交する方向であるトラッキング方向に 可動制御されてトラッキング調整され、上記光磁気ディ スクの信号記録面の記録トラックに追従するように光ビ ームが正確に集光するようになる。このように、いわゆ る閉ループ制御を行うことにより、上記対物レンズ9が 駆動変位され、フォーカス制御及びトラッキング制御を 行うことができる。

【0018】このように、対物レンズ9をフォーカス及 40 びトラッキング制御させるアクチュエータを、一対のバ イモルフ型圧電素子7,7と一対の積層型圧電素子1 0,10とで構成するが、フォーカス制御の駆動はレン ズホルダー8と対物レンズ9だけで可動範囲が小さくて 済むので、各バイモルフ型圧電素子7の歪曲で行い、ト ラッキング制御の駆動はレンズホルダー8と対物レンズ 9と一対のバイモルフ型圧電索子7,7及びベース3の ヒンジ部3bなので可動範囲が大きくなり、各積層型圧 電素子10の歪曲で行う。

6

素子7と、機械的剛性の高い積層型圧電素子10とを組 み合わせた構造としたことにより、フォーカス方向及び トラッキング方向の両方向において1次共振をともに高 く(高剛性に)することができる。よって、対物レンズ 9をフォーカス方向とトラッキング方向の2軸方向に駆 動変位させる対物レンズ駆動装置1において、フォーカ ス方向とトラッキング方向の両方向において構造的に高 剛性でありながら広い周波数帯域に亙ってサーボゲイン を高くとる(高ゲインの駆動制御を行う)ことができ、 また、耐振性・耐衝撃性を大幅に改善することができ る。この高性能・高信頼性の対物レンズ駆動装置1を内 蔵した光学ピックアップ装置を光磁気ディスク駆動装置 等に用いれば、対物レンズ駆動装置1が振動衝撃を受け た時でも対物レンズ9が動きにくくてデフォーカスやオ フトラックを確実に防ぐことができると共に、光磁気デ ィスクの情報記録面に高密度で記録された情報信号を高 速で読み取ったり、高速で書き込むことができて高速な アクセス性能を発揮させることができる。

【0020】図4は、この発明の第2の実施形態例の対 物レンズ駆動装置1′を示す。第1の実施形態の対物レ ンズ駆動装置1では一対の積層型圧電素子10,10を ベース3のヒンジ部3bを挾むように該ヒンジ部3bに 対して平行になるように配設したが、この第2の実施形 態の対物レンズ駆動装置1′では、ベース3のヒンジ部 3 bを挾むように該ヒンジ部 3 bに対して垂直(各積層 型圧電素子10とベース3の前部3cとが直線状)にな るように配設した点が異なるのみであり、第1の実施形 態と同様の動作をする。これにより、第1の実施形態の 対物レンズ駆動装置1では、長さが長くて幅が狭いのに 基づく電圧がそれぞれ印加されると、各積層型圧電素子 30 対し、第2の実施形態の対物レンズ駆動装置 1′では、 長さが短くて幅が広くなっていて、光学ピックアップ装 置に搭載するときに、その設置スペースの前後, 左右方 向の大小等によりそれぞれ使い分けて設置することがで

> 【0021】尚、前記各実施形態例によれば、光磁気デ ィスク駆動装置に内蔵された光学ピックアップ装置に用 いられる対物レンズ駆動装置について説明したが、光デ ィスク駆動装置やCD-ROM(コンパクトディスク読 み出し専用メモリー)装置や光学式ロータリーエンコー ダ装置等の他の駆動装置に前記各実施形態例を適用でき ることは勿論である。

#### [0022]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、対物 レンズと、この対物レンズをフォーカス方向に可動自在 に支持したフォーカス調整駆動用のバイモルフ型圧電素 子と、上記対物レンズをトラッキング方向に可動自在に 支持したトラッキング調整駆動用の積層型圧電素子とを 備えたことにより、上記フォーカス方向とトラッキング 方向の2軸方向の対物レンズに対する耐振性と耐衝撃性 【0019】また、機械的剛性の低いバイモルフ型圧電 50 を共に向上させることができ、また、構造的にシンプル

であるために高性能及び高信頼性を得ることができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1の実施形態例の対物レンズ駆動 装置を示す斜視図。

【図2】 (a) は、上記対物レンズ駆動装置のフォーカ ス制御前の状態を示す側面図、(b)は、同装置のフォ ーカス制御時の状態を示す側面図。

【図3】 (a) は、上記対物レンズ駆動装置のトラッキ ング制御前の状態を示す平面図、(b)は、同装置のト ラッキング制御時の状態を示す側面図。

【図4】第2の実施形態例の対物レンズ駆動装置を示す 斜視図。

【図5】従来例の対物レンズ駆動装置の斜視図。

#### 【符号の説明】

1, 1′…対物レンズ駆動装置

3, 3' …ベース

3 b…ヒンジ部

7…バイモルフ型圧電素子(フォーカス調整駆動用圧電 素子)

7 a …基端部 (他端部)

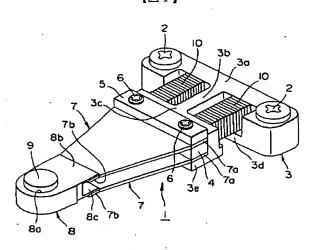
7 b…先端部 (一端部)

8…レンズホルダー

9…対物レンズ 10

> 10…積層型圧電素子(トラッキング調整駆動用圧電素 子)

【図1】



1,1′…対物レンズ駆動装置

(イモルフ型圧電素子(フォーカス調整駆動用圧電素子)

7 a…基端部(他端部)

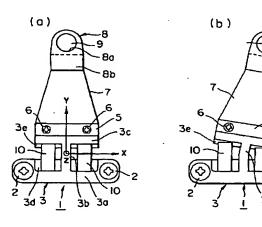
7 b…先端部(一端部)

8…レンズホルダ・

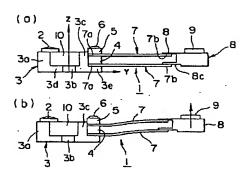
9 …対物レンズ

10…積層型圧電業子(トラッキング調整駅動用圧電素子)

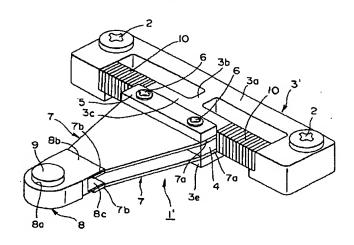
【図3】



### 【図2】



【図4】



【図5】

